#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05257176 A

(43) Date of publication of application: 08.10.93

(51) Int. CI

G02F 1/35

(21) Application number: 04055678

(22) Date of filing: 13.03.92

(71) Applicant:

**NIPPON TELEGR & TELEPH** 

CORP <NTT>

(72) Inventor:

NAKANO HIDETOSHI TSUKADA MASAHITO

ISHIDA YUZO

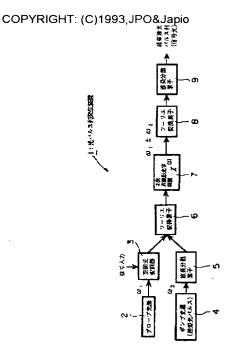
# (54) LIGHT PULSE TRAIN GENERATION DEVICE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To generate an ultra high bit rate light signal train (signal light) efficiently at a high speed and to performs even the parametric amplification of the signal light at the time of spatial filtering execution on a Fourier transformation surface.

CONSTITUTION: The light pulse train generation device 1 features the arrangement of a probe light source 2 which generates the light signal, a spatial optical modulator 3, a pump light source 4 which generates ultra short light pulses, a 1st wavelength dispersing element 5 which spectrally decomposes the ultra short light pulses, a 1st Fourier transforming element 6 which processes the light signal and ultra short light pulses by Fourier transformation, a secondary nonlinear optical medium 7 which makes the light signal and ultra short light pulses into a time-series light signal through nonlinear mutual operation, a 2nd Fourier transforming element 8 which processes the light signal by Fourier transformation, and a 2nd wavelength dispersing element 9 which spectrally composes the Fourier-transformed light signal. Further, plural probe light sources may be

### arranged linearly.



### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平5-257176

(43)公開日 平成5年(1993)10月8日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 F 1/35

7246-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平4-55678

(22)出願日

平成 4年(1992) 3月13日

(71)出額人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 中野 秀俊

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 塚田 雅人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 石田 祐三

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

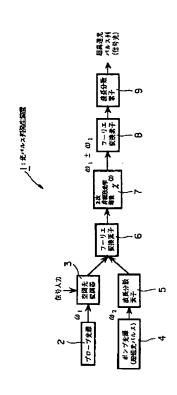
(74)代理人 弁理士 志賀 正武

### (54) 【発明の名称 】 光パルス列発生装置

### (57) 【要約】

【構成】 本願発明の光パルス列発生装置1は、光信号を発生させるプローブ光源2と、空間光変調器3と、超短光パルスを発生させるポンプ光源4と、超短光パルスをスペクトル分解する第1の波長分散素子5と、光信号及び超短光パルスをフーリエ変換する第1のフーリエ変換素子6と、光信号及び超短光パルスを非線形相互作用させ時系列光信号とする2次非線形光学媒質7と、この光信号をフーリエ変換する第2のフーリエ変換素子8と、フーリエ変換された光信号をスペクトル合成する第2の波長分散素子9とを具備してなることを特徴とする。また、複数のプローブ光源を一次元に配置させてもよい。

【効果】 効率的かつ高速に可変の超高ビットレート光信号列(信号光)を発生させることができ、フーリエ変換面における空間フィルタリング実行時に信号光のパラメトリック増幅をも併せて行うことができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プローブ光源と、該プローブ光源から発生する光信号を空間光変調する空間光変調器と、超短光パルスを発生させるポンプ光源と、該ポンプ光源から発生する超短光パルスをスペクトル分解する第1の波長分散素子と、前記空間光変調器から発生する光信号及び制力を発生する超短光パルスをそれぞれフーリエ変換素子から発生する超短光パルスを発生させるリエ変換素子から出射される光信号を発生させる2次非線形光学媒質と、該2次非線形光学媒質から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子がら発生する時系列光信号をフーリエ変換素子とを非線形光学なることを特徴とする光パルス列発生装置。

【請求項2】 一次元に配置される複数のプローブ光源と、超短光パルスを発生させるポンプ光源と、該ポンプ 光源から発生する超短光パルスをスペクトル分解する第 1の波長分散素子と、前記複数のプローブ光源から発生する各々の光信号及び波長分散素子から発生する超変複素子から発生する田のフーリエ変換素子から出射される時素子と、該第 1のフーリエ変換素子から出射される時系列光信号を発生させる 2次非線形光学媒質と、該 2次非線形光学媒質から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子から発生する時系列光信号をスペクトル合成する第 2の波長分散素子とを具備してなることを特徴とする光パルス列発生装置。

【請求項3】 請求項1または2記載の光パルス列発生装置において、

前記ポンプ光源は、共振器内部に第2高調波発生用の非 線形光学媒質を具備してなることを特徴とする光パルス 列発生装置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、時分割多重方式による 大容量光通信及びその交換において好適に用いられ、空間フーリエ変換された並列入力信号を実時間的に処理し 時系列信号へ変換する光パルス列発生装置に関するもの である。

## [0002]

【従来の技術】将来の大容量光通信技術の一つの方向として、例えば、光ソリトン通信方式に見られるような超短光パルス列による時分割多重通信方式が考えられている。また、近年、急激に進歩しつつある超短光パルス発生技術においては、光の振動周期にして僅か3サイクルに相当する6フェムト秒の光パルス幅を実現するに至っている(参考文献1:R.L.Fork, C.H.Brito-Cruz, P.C.Becker, and C.V.Shank, Opt. Lett. 12, 483(198

7))。そして、このような超短光パルスを用いれば、原 理的には100Tb/s程度の高ビットレート光パルス 列を発生させることが期待できるのであるが、実際に は、極限的に幅の狭い光パルスはレーザ装置から高々数 十Hzの繰り返しで発生するのみである。また、一方で は、半導体レーザの利得スイッチング法で直接数十GH z程度の繰り返しの光短パルス列が実現されているが、 光パルス幅は数ピコ秒程度に留まり、より光パルス幅の 狭い超短光パルスを発生するまでには至っていない。そ こで、ビットレートの低い光パルス列を高ビットレート 化することにより、より光パルス幅の狭い超短光パルス を発生させる試みがなされており、例えば、時間軸上で 直接操作する手法として、光ファイバ遅延線と高速光ス イッチを用いる方法が考えられている(参考文献2:M. Tsukada and Y. Shimazu, Electron. Lett. 26, 1895 (19 90))。

【0003】また、光の周波数領域で処理を行う手法も 提案されている(参考文献3: A.M. Weiner, J.P. Herita ge, and E.M.Kirschner, J. Opt. Soc. Am. B 5, 1563 (1988))。この方法は、超短光パルスがもともと広い波 長域にわたるスペクトルを有していることに着目して行 われる処理であり、使用する素子の応答速度に対する要 請が軽く、任意の光パルス波形(例えば、矩形波)を実 現する能力をも有する点で優れた手法である。この方式 では、波長分散素子とフーリエ変換素子とを組み合わせ て用いることにより、光パルスの周波数情報を空間的な 位置情報に変換する。次に、フーリエ変換面で空間フィ ルタリングを実行することによって、位相および振幅変 調を施す。その後、再度フーリエ変換素子と波長分散素 子とを組み合わせた光学系を通過させることにより、時 系列信号に逆変換し、任意の光パルス系列を発生させ る。すなわち、この方式では、時間領域と共役関係にあ る周波数領域での処理を光波情報処理の最大の利点であ る並列処理性を活用して実行している。それゆえ、素子 の応答速度に対する要請を軽減することが可能となって いる。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した光の周波数領域で処理を行う手法においては、空間フィルタとして、発生させるべき時間波形のフーリエ変換に相当する透過率/位相特性を有するマスクを準備することが必要となる。該マスクの最も簡単なものはフーリエ変換ホログラムである(参考文献4:K.Ema and F.Shimizu, Jpn. J.Appl. Phys. 29,L631(1990))が、固定のホログラムを用いたのでは、次々と信号波形を書き換えることが不可能である。また、液晶空間光変調器等を用いることも可能である。また、液晶空間光変調器等を用いることも可能である(参考文献5:A.M.Weiner, D.E.Leaird, J.S.Patel, and J.R.Wullert, Opt.Lett. 15,326(1990))が、応答速度が遅いことならびに、発生すべき時間波形のフーリエ変換を計算しなくてはならなことなどの

問題があり、やはり次々と光パルス列 (波形) を書き換える用途への適用は困難である。

【〇〇〇5】前記ホログラムの実時間化としては、非線形光学媒質中での3次非線形応答特性を用いた縮退四光波混合の応用、光誘起屈折率効果の応用が考えられている(参考文献6:K.Ema, M.K.Gonogami, and F.Shimizu, Appl. Phys. Lett. 59, 2799(1991))。しかしながら、一般に、3次非線形応答特性は比較的高速応答性を示すものの効果が小さいという欠点がある。例えば、一部の半導体励起子遷移のように比較的大きな非線形性を示すものもあるが、これらはほとんど極低温状態でのみ存在するという欠点があり、実用性が極めて乏しい。これに対し、光誘起屈折率効果は一般に効率が高いものの応答が遅いという欠点がある。

【0006】時分割多重方式による通信容量の増加のためには、短パルスを使用した高ビットレートパルス列の発生が必須であるが、レーザ光源の直接変調法による手法では、ピコ秒以下の超短パルス化が困難なことから、ビットレートに制約が生じる。そこで、ピコ秒からサブピコ秒に至る光パルスまで任意の高速パルス列を合成するためには、実時間的に書き換え可能な空間フィルタを準備する必要がある。しかしながら、この空間フィルタとして3次非線形分極を利用すれば回折効率が低くなり、光誘起屈折率効果を用いれば応答速度が低くなるという問題点がある。

【0007】本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、従来の様々な問題点や欠点を解決するとともに、高効率と高速応答を実現し、超高ビットレートの光信号パルス列を合成することのできる光パルス列発生装置を提供することにある。

### [0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は下記の様な光パルス列発生装置を採用し た。すなわち、請求項1記載の光パルス列発生装置は、 プローブ光源と、該プローブ光源から発生する光信号を 空間光変調する空間光変調器と、超短光パルスを発生さ せるポンプ光源と、該ポンプ光源から発生する超短光パ ルスをスペクトル分解する第1の波長分散素子と、前記 空間光変調器から発生する光信号及び波長分散素子から 発生する超短光パルスをそれぞれフーリエ変換する第1 のフーリエ変換素子と、該第1のフーリエ変換素子から 出射される光信号及び超短光パルスを非線形相互作用さ せて時系列光信号を発生させる2次非線形光学媒質と、 該2次非線形光学媒質から発生する時系列光信号をフー リエ変換する第2のフーリエ変換素子と、該第2のフー リエ変換素子から発生する時系列光信号をスペクトル合 成する第2の波長分散素子とを具備してなることを特徴

【0009】また、請求項2記載の光パルス列発生装置は、一次元に配置される複数のプローブ光源と、超短光

パルスを発生させるポンプ光源と、該ポンプ光源から発生する超短光パルスをスペクトル分解する第1の波長分散素子と、前記複数のプローブ光源から発生する各々の光信号及び波長分散素子から発生する超短光パルスをそれぞれフーリエ変換素子から出射される複数の光信号を第1のフーリエ変換素子から出射される複数の光信号を発生させる2次非線形光学媒質と、該2次非線形光信号を発生させる2次非線形光学媒質と、該2次非線形光空媒質から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子から発生する時系列光信号をスペクトル合成する第2の波長分散素子とを具備してなることを特徴としている。

【0010】また、請求項3記載の光パルス列発生装置は、請求項1または2記載の光パルス列発生装置において、前記ポンプ光源は、共振器内部に第2高調波発生用の非線形光学媒質を具備してなることを特徴としている。

### [0011]

【作用】本発明の請求項1記載の光パルス列発生装置では、前記プローブ光源から発生する光信号は空間光変調器により空間光変調される。一方、前記ポンプ光源から発生する超短光パルスは第1の波長分散素子によりスペクトル分解される。前記空間光変調器から発生する光信号及び波長分散素子から発生する超短光パルスは第1のフーリエ変換素子に入射されてそれぞれが個別にフーリエ変換される。

【 O O 1 2 】 フーリエ変換された光信号及び超短光パルスは、2次非線形光学媒質内で非線形相互作用し時系列光信号となって該2次非線形光学媒質から出射される。この時系列光信号は第2のフーリエ変換素子においてフーリエ変換され、さらに第2の波長分散素子においてスペクトル合成されて出射される。

【0013】ここで、空間光変調器への入力光信号パターンをそのまま光パルス列に変換するのであれば、プローブ光はCW光(連続発振光)または、超短光パルスと同じタイミングで非線形光学媒質に入射する単純な光パルス列であれば良い。この光パルス列発生装置では、効率的かつ高速に可変の超高ビットレート光信号列(信号光)を発生させることが可能となり、フーリエ変換面における空間フィルタリング実行時に信号光のパラメトリック増幅をも併せて行うことが可能となる。

【0014】また、請求項2記載の光パルス列発生装置では、一次元に配置される複数のプローブ光源から発生する光信号及び第1の波長分散素子によりスペクトル分解される超短光パルスは、第1のフーリエ変換素子に入射されてそれぞれが個別にフーリエ変換される。

【 0 0 1 5 】 フーリエ変換された光信号及び超短光パルスは、2次非線形光学媒質内で非線形相互作用し時系列光信号となって該2次非線形光学媒質から出射される。この時系列光信号は第2のフーリエ変換素子においてフ

一リエ変換され、さらに第2の波長分散素子においてス ペクトル合成されて出射される。

【0016】これより、空間光変調器を使わずに空間パ ターンを実現することが可能になる。また、この空間パ ターンが出力される光信号の時系列パターンとなるの で、個々のプローブ光信号列が置かれた位置に対応して 時間的にずれて多重化されることになり、入力信号のビ ットレートを変えることなく多重化する (ビット多重) ことが可能になる。

【0017】また、請求項3記載の光パルス列発生装置 では、前記ポンプ光源の共振器内部に第2高調波発生用 の非線形光学媒質を具備することにより、基本波と第2 高調波の光パルスを高効率で得ることが可能になる。し たがって、第2高調波をポンプ光とし、基本波をプロー ブ光として用いることにより、同一のパルス光源を用い た送受信装置とすることが可能になる。

#### [0018]

【実施例】以下、本発明に係る光パルス列発生装置につ いて説明する。

(第1実施例)図1は光パルス列発生装置1の構成図で ある。この光パルス列発生装置1は、プローブ光源2 と、プローブ光源2から発生する光信号を空間光変調す る空間光変調器3と、超短光パルスを発生させるポンプ 光源4と、ポンプ光源4から発生する超短光パルスをス ペクトル分解する第1の波長分散素子5と、空間光変調 器3から発生する光信号及び波長分散素子5から発生す る超短光パルスをそれぞれフーリエ変換する第1のフー

$$E_{p1}(x,t) \propto E_{in}(t-a_{in}x)$$

と表される。ここで、ainは入射側に置いた波長分散素 子の分散量を与えるパラメータである。

【0022】次に、フーリエ変換素子6(フーリエ変換 レンズ、放物面鏡等から構成される)により、フーリエ

$$E_{p2}\{x,t\} \propto \mathcal{E}_{in}\left(-\frac{\alpha_{pu}}{a_{in}}x\right) \exp\left(-i\frac{\alpha_{pu}}{a_{in}}xt\right) \cdots (2)$$

で与えられる。ここで、E(Nx)は、E(x)の空間 フーリエ変換を意味し、

$$\mathcal{E}(N_x) = \int_{-\infty}^{\infty} E(x) e^{-iN_x x} dx$$

で定義される。ここで、 $\alpha_{DU}$ はポンプ光の波長 $\lambda_{DU}$ と入 射側のフーリエ変換素子の焦点距離 f 1により決定され るパラメータである。

【0023】このフーリエ変換面に2次非線形応答を示 す2次非線形光学媒質7を設置する。一方、プローブ光 源2から発生するプローブ光は、空間変調器3により空 間変調(波面内での振幅・位相変調、すなわち濃淡分布

$$E_2(x) \propto \mathcal{E}_1(\alpha_{pr} x)$$

リエ変換素子6と、第1のフーリエ変換素子6から出射 される光信号及び超短光パルスを非線形相互作用させて 時系列光信号を発生させる2次の非線形感受率 x (2)を 有する2次非線形光学媒質7と、2次非線形光学媒質7 から発生する時系列光信号をフーリエ変換する第2のフ ーリエ変換素子8と、第2のフーリエ変換素子8から発 生する時系列光信号をスペクトル合成する第2の波長分 散素子9とから構成されている。

【〇〇19】ここで、プローブ光源2から発生されるプ ローブ光は、空間光変調器への入力光信号パターンをそ のまま光パルス列に変換するのであれば、CW光(連続 発振光)または、超短光パルスと同じタイミングで非線 形光学媒質に入射する単純な光パルス列であれば良い。

【0020】次に、光パルス列発生装置1の特徴であ る、2次非線形光学媒質7のパラメトリック非線形相互 作用によりピコ〜サブピコ秒光パルスから高ビットレー ト光パルス列を発生させる原理について説明する。ポン プ光源4から発生した超短光パルスは、波長分散素子5 (回折格子、波長分散プリズム等から構成される) によ り、スペクトル分解され、成分ごとに異なった角度で進 行する。すなわち、ここでは、ポンプ光のスペクトル情 報が空間周波数情報に変換される。

【0021】スペクトル分解されたポンプ光の電界振幅 Ep1(x, t)は、波長分散素子5への入射光電界振幅 Ein(t)を用いて、

【数1】

変換面(焦点面)上で空間周波数情報(波長成分)が位 置情報に変換される。フーリエ変換面でのポンプ光の電 界振幅 Ep2 (x, t) は、

$$\exp\left(-i\,\frac{\alpha_{\rho u}}{a_{in}}\,x\,t\,\right)\qquad\cdots\qquad(2)$$

的な変調)が施され、フーリエ変換素子6によって2次 非線形光学媒質 7 面上に、変調された波面情報の空間フ 一リエ変換像が現れる。つまり、プローブ光が作る像の 電界振幅E2(x)は、変調前のプローブ光パターンが 一様と仮定すれば、空間変調信号E1(x)のフーリエ 変換に比例したものとなっており、次式で与えられる。

ここで、 $\alpha_{pr}$ はプローブ光の波長 $\lambda_{pr}$ とフーリエ変換素子6の焦点距離 f  $\gamma$ により決定されるパラメータである。

【0024】スペクトル分解されたポンプ光のフーリエ変換波面と空間変調されたプローブ光のフーリエ変換波面とが同時に2次非線形光学媒質7中に入射することにより、両者の電界の積に比例した非線形双極子モーメン

$$E_3(x,t) \propto d_{eff}E_2(x)E_{p2}(x,t)$$

トが該2次非線形光学媒質7中に誘起される。誘起された非線形双極子モーメントによる輻射電界が、非線形相互作用の結果としての新たな信号光を生み出す。すなわち、信号電界振幅E3(x, t)は、deffを2次の非線形光学定数として、和周波発生のときには、

【数5】

$$\approx d_{eff} \, \mathcal{E}_1 \left( \alpha_{pr} \, x \right) \mathcal{E}_{p1} \left( -\frac{\alpha_{pu}}{a_{in}} \, x \right) \exp \left( -i \, \frac{\alpha_{pu}}{a_{in}} \, x \, t \right) \, \cdots \, (5)$$

【数6】

となり、差周波発生のときには、

$$E_{3}(x,t) \propto d_{eff} E_{2}^{*}(x) E_{p2}(x,t)$$

$$\propto d_{eff} E_{1}^{*}\left(-\alpha_{pr}x\right) E_{p1}\left(-\frac{\alpha_{pu}}{a_{in}}x\right) \exp\left(-i\frac{\alpha_{pu}}{a_{in}}xt\right) \cdots (6)$$

となる。

【0025】ここで、 $\alpha_{out} = \alpha_{pu}$ となるように配置、 すなわちプローブ光および信号光の波長をそれぞれ

$$\lambda_{pu} \cdot f_1 = \lambda_{sig} \cdot f_2$$

を満たすように配置しておけば、発生した信号は、出力 側に設けたフーリエ変換素子8により、再度フーリエ変 換を受け、出射側の波長分散素子9面上での電界振幅E  $\lambda_{pu}$ 、 $\lambda_{sig}$ 、入力側のフーリエ変換素子6の焦点距離を $f_1$ 、出力側のフーリエ変換素子8の焦点距離を $f_2$ として、

**4 (x, t) は、和周波発生のときには、** 【数7】

$$E_{4}(x,t) \propto d_{eff} E_{3}(t,x)$$

$$\propto d_{eff} E_{1}\left(-\frac{\alpha_{pu}}{\alpha_{pr} a_{in}}(t+a_{in}x)\right) \bigcirc E_{in}(t+a_{in}x) \cdots (8)$$

となり、差周波発生のときには、

$$E_4(x,t) \propto d_{eff} E_3(t,x)$$

$$\propto d_{eff} E_1^* \left( \frac{\alpha_{pu}}{\alpha_{pr} a_{in}} (t + a_{in} x) \right) \bigcirc E_{in}(t + a_{in} x) \cdots (9)$$

となる。

【0026】従って、出射側の波長分散素子9の分散量が入射側と同じであれば、逆変換の結果として得られる

出力信号波形(電界振幅) E<sub>out</sub> (t) は、和周波発生時には、

【数9】

$$E_{out}(t) \propto d_{eff}E_1\left(-\frac{\alpha_{pu}}{\alpha_{pr}a_{in}}t\right) \bigcirc E_{in}(t)$$
 (10)

となり、差周波発生時には、

$$E_{out}(t) \propto d_{eff} E_1^* \left( \frac{\alpha_{pu}}{\alpha_{nr} a_{in}} t \right) \bigcirc E_{in}(t)$$
 ....(11)

となる。ここで、〇は畳み込み演算を表す。すなわち、この装置から発生する光信号パルス列 (パルス波形) は、種とする超短光パルス (ポンプ光) と空間光変調器 に入力する変調信号との畳み込みとなる。以上が、超短光パルスを種として超高速ビット列を発生する動作原理である。

【0027】この光パルス列発生装置1によれば、効率的かつ高速に可変の超高ピットレート光信号列(信号光)を発生させることができ、フーリエ変換面における空間フィルタリング実行時に信号光のパラメトリック増幅をも併せて行うことができる。

【0028】次に、本発明の光パルス列発生装置をより 具体化した各実施例について説明する。

(第2実施例)図2は、差周波発生方式により光パルス列を発生させる光パルス列発生装置11の構成図である。この光パルス列発生装置11は、プローブ光源2と、空間光変調器3と、ポンプ光源4と、回折格子(第1の波長分散素子)12と、フーリエ変換レンズ(第1のフーリエ変換レンズ(第2のフーリエ変換素子)14と、回折格子(第2の波長分散素子)15とから構成されている。なお、図中の「f」はフーリエ変換レンズ13の焦点距離を、「f/2」はフーリエ変換レンズ14のの焦点距離をそれぞれ表わしている。

【0029】ここで、フーリエ変換レンズ13の焦点距離をf、回折格子12の溝間隔を $\Lambda$ とすれば、フーリエ変換レンズ14の焦点距離をf/2、回折格子15の溝間隔を $2\Lambda$ とすることが必要である。このようにすれば、回折格子12と回折格子15との幾何学的配置を対称にすることにより、2つの回折格子12、15による分散量を同一にすることができる。

【0030】プローブ光源2としては、1.55 $\mu$ mのプローブ光 $_1$ を発振させることのできる半導体レーザ等が、また、ポンプ光源4としては、中心波長775 $_1$ mのポンプ光 $_2$ を発振させることのできる受動モード同期チタンドープサファイアレーザ( $_1$ i:Al203レーザ)等が好適に用いられる。この場合、差周波として1.55 $\mu$ mの信号光 $_3$ を得ることができる。この波長帯は、光通信において有用な波長である。

【 0 0 3 1】また、2次非線形光学媒質 7 としては、K T P (K T i O P O 4)、β - B B O (B a B 2 O 4)、 L B O (L i B 3 O 5)、L i N b O 3 等が好適に用いら れる。

【0032】この光パルス列発生装置 1 1 では、入射するポンプ光  $L_2$ の中心周波数を  $2\omega$ 、プローブ光  $L_1$ の中心周波数を  $\omega$  とすれば、差周波信号として中心周波数  $\omega$  の信号光  $L_3$ を発生させることができ、特に、回折格子 1 2 として溝間隔 555 nm(1800 l i nes/mm)のものを用い、ポンプ光源から発振される超短パルス光のパルス幅を 90 f s とした場合には、原理的には

およそ9 T b / s の超高ビットレート光信号列を発生させることができる。

【0033】なお、フーリエ変換レンズ13、14の替わりに同一の焦点距離を有する放物面鏡(フーリエ変換素子)を用いても同一の作用・効果を奏することができる。放物面鏡は、パルス幅が短くなったときに波長分散および色収差の悪影響を取り除く意味で有効な手段である。

【0034】(第3実施例)図3は、和周波発生方式により光パルス列を発生させる光パルス列発生装置21の構成図である。この光パルス列発生装置21は、第2実施例の光パルス列発生装置11と同一の構成要素からなるもので、上述した光パルス列発生装置11と異なる点は、入射するポンプ光の中心周波数をωとした点と、フーリエ変換レンズ13の焦点距離をf、回折格子12の溝間隔をΛとしたときに、フーリエ変換レンズ14の焦点距離が2f、回折格子15の溝間隔がΛ/2となるように、フーリエ変換レンズ14及び回折格子15を選択した点である。

【0035】この光パルス列発生装置21によれば、2次非線形相互作用により和周波の発生を実現することができる。代表的なものは第2高調波発生(SHG)である。入射するポンプ光 L 2とプローブ光 L 1の中心周波数を共にωとすれば、2ωの周波数の信号光 L 3を発生させることができる。特に、プローブ光源2およびポンプ光源4として受動モード同期チタンドープサファイアレーザを用いれば、近紫外域において任意波形の高繰り返し光パルス列を発生することができる。この波長域の光パルス列は、IIーVI属化合物半導体の分光研究などにおいて重要なものである。

【0036】(第4実施例)図4は、差周波発生方式によりビット多重化した光パルス列を発生させる光パルス列発生装置31の構成図である。この光パルス列発生装置31は、第2実施例の光パルス列発生装置11のプローブ光源2及び空間光変調器3を、1次元アレイ状に配列した3つのプローブ光源2a~2cに置き換えたものであり、この構成要素以外の構成要素については光パルス列発生装置11と全く同一である。

【0037】この光パルス列発生装置31によれば、個々のプローブ光源2a~2cから出射される各プローブ光源2a~2cから出射される各プローブ光により光パルスを多重化することができる。この装置31では、各チャンネルがプローブ光源2a~2cの位置に対応する。個々のプローブ光源2a~2cとして、1.55 $\mu$ mで発振する半導体レーザを用いれば、直接変調により受動モード同期チタンドープサファイアレーザ(775nm)の繰り返し周期程度のビットレートの信号パルス列を実現することができる。

【0038】(第5実施例)図5は、入射光源として基本波と第2高調波を発生させることのできる光パルス列発生装置41の構成図である。この光パルス列発生装置

41は、第2実施例の光パルス列発生装置11のポンプ 光源4を共振器内部に第2高調波発生用の非線形光学結 晶(媒質)を配置した超短光パルスレーザ42に置き換 え、さらに、回折格子(波長分散素子)43.44、ミ ラー45,45.…、フーリエ変換レンズ13、2次非 線形光学媒質7、フーリエ変換レンズ14を付加した構 成である。なお、46は光検出器アレイ(光パルス検出 装置)である。

【0039】この光パルス列発生装置41では、超短光パルスレーザ42から高効率で基本波と第2高調波の光パルスを同時に得ることができる。もちろん共振器外部に2次非線形光学媒質を置いて第2高調波発生を行なわせることにより同様の光パルス列発生装置を構成することは可能であるが、装置全体が大型かつ複雑になり好ましくない。また、第2高調波の発生効率等を勘案すると超短光パルスレーザ42を用いる利点は極めて大きい。

【0040】また、第2高調波をポンプ光し2として用 い、基本波を光検出器アレイ46のプローブ光L4とし て用いることにより、同一のパルス光源を用いた送受信 装置とすることができる。例えば、超短パルス光源とし て、受動モード同期チタンドープサファイアレーザを用 いれば、800mm付近の波長帯で発振する光パルスを 送信側のプローブ光とすることにより、800mm付近 の波長帯での光パルス送受信装置を構成することができ る。また、超短パルスレーザ光源として、Cr⁴+: YA Gレーザのように 1.  $3 \mu m \sim 1$ .  $5 \mu m$ の波長域に利 得を有するレーザを用いれば、1.3μmまたは1.5 μmで発振する半導体レーザ光を送信側のプローブ光と することにより、1. 3μm帯または1. 5μm帯の光 パルス送受信装置を構成することができる。また、第4 実施例の光パルス列発生装置31に示す様に、送信側の プローブ光源を半導体レーザのリニアアレイとすれば、 ビット多重方式のマルチプレクサとデマルチプレクサを 構成することができる。

#### [0041]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明の請求項1記載の光パルス列発生装置によれば、プローブ光源と、該プローブ光源から発生する光信号を空間光変調する空間光変調器と、超短光パルスを発生させるポンプ光源から発生する超短光パルスをスペクトル分解する第1の波長分散素子と、前記空間光変調器がパルスを発生する光信号及び波長分散素子とで見から発生する光信号をひから発生する光信号をのフーリエ変換素子がら出射される光信号をルスをそれぞれフーリエ変換素子がら出射される光信号をルスを非線形光学媒質と、該2次非線形光信号を現から発生する時系列光信号をフーリエ変換素子が良発する時系列光信号をスペクトル合成する第2の波像素子とを具備してなることとしたので、効率的かつ高

速に可変の超高ビットレート光信号列(信号光)を発生 させることができ、フーリエ変換面における空間フィル タリング実行時に信号光のパラメトリック増幅をも併せ て行うことができる。

【0042】また、請求項2記載の光パルス列発生装置 によれば、一次元に配置される複数のプローブ光源と、 超短光パルスを発生させるポンプ光源と、該ポンプ光源 から発生する超短光パルスをスペクトル分解する第1の 波長分散素子と、前記複数のプローブ光源から発生する 各々の光信号及び波長分散素子から発生する超短光パル スをそれぞれフーリエ変換する第1のフーリエ変換素子 と、該第1のフーリエ変換素子から出射される複数の光 信号及び超短光パルスを非線形相互作用させて時系列光 信号を発生させる2次非線形光学媒質と、該2次非線形 光学媒質から発生する時系列光信号をフーリエ変換する 第2のフーリエ変換素子と、該第2のフーリエ変換素子 から発生する時系列光信号をスペクトル合成する第2の 波長分散素子とを具備してなることとしたので、空間光 変調器を使わずに空間パターンを実現することができ る。また、この空間パターンが出力される光信号の時系 列パターンとなるので、個々のプローブ光信号列が置か れた位置に対応して時間的にずれて多重化されることと なり、入力信号のビットレートを変えることなく多重化 する(ビット多重)ことができる。

【0043】また、請求項3記載の光パルス列発生装置によれば、請求項1または2記載の光パルス列発生装置において、前記ポンプ光源は、共振器内部に第2高調波発生用の非線形光学媒質を具備してなることとしたので、基本波と第2高調波の光パルスを高効率で得ることができる。したがって、第2高調波をポンプ光とし、基本波をプローブ光として用いることにより、同一のパルス光源を用いた送受信装置とすることができる。

【 O O 4 4 】以上により、従来のレーザの直接変調などでは実現不可能であった超高ビットレート光パルス列を高速かつ高効率で実現することができる光パルス列発生装置を提供することができる。さらに、種になる超短短光ルス光源が同一であっても、光学系中のフーリエ変換子の焦点距離の組み合わせ、2次非線形光学媒質の起気光パルス列を発生さることができる。また、超短パルス列を発生を選べば、各種波長域の超短光パルス列を発生を退べば、各種波長域の超短光パルス列を発生を表したができる。また、超短パルスーザ光源の共振器を発生のおいた光源を準備成することにより、超高速光パルスに光源を準備成することが可能となる等の効果も表することができる。これらは、将来の超大容量光通信とびに交換技術に大きく貢献するものであり、11ーV1属化合物半導体などの光学材料の超高速緩和現象等の分光研究においても有益なものである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の光パルス列発生装置を示す構成図である。

【図2】本発明の第2実施例の差周波発生方式の光パルス列発生装置を示す構成図である。

【図3】本発明の第3実施例の和周波発生方式の光パルス列発生装置を示す構成図である。

【図4】本発明の第4実施例のビット多重化した光パルス列を発生させる光パルス列発生装置を示す構成図である。

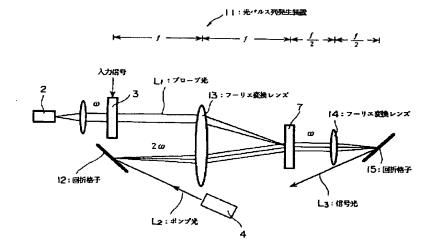
【図5】本発明の第5実施例の基本波と第2高調液を発生させることのできる光パルス列発生装置を示す構成図である。

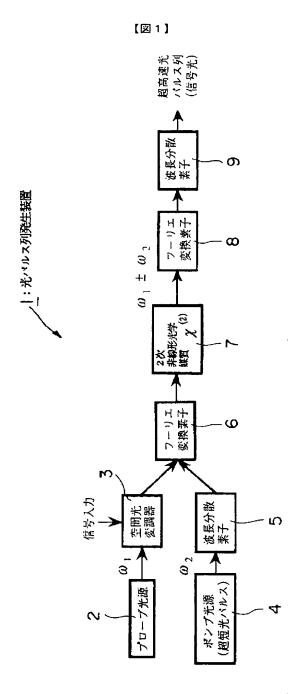
#### 【符号の説明】

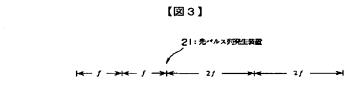
- 1 光パルス列発生装置
- 2 プローブ光源
- 3 空間光変調器
- 4 ポンプ光源
- 5 第1の波長分散素子
- 6 第1のフーリエ変換素子
- 7 2次非線形光学媒質
- 8 第2のフーリエ変換素子

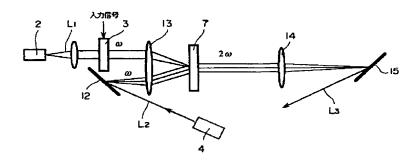
- 9 第2の波長分散素子
- 11 光パルス列発生装置
- 12 回折格子 (第1の波長分散素子)
- 13 フーリエ変換レンズ (第1のフーリエ変換素子)
- 14 フーリエ変換レンズ (第2のフーリエ変換素子)
- 15 回折格子 (第2の波長分散素子)
- 21 光パルス列発生装置
- 31 光パルス列発生装置
- 41 光パルス列発生装置
- 42 超短光パルスレーザ
- 43,44 回折格子(波長分散素子)
- 45 ミラー
- 46 光検出器アレイ(光パルス検出装置)
- L1 プローブ光
- L2 ポンプ光
- L3 信号光
- L4 プローブ光
- L11~L13 プローブ光

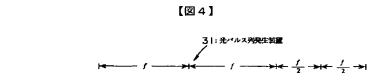
【図2】

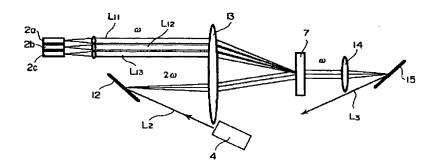












【図5】

